

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2008-137306

(P2008-137306A)

(43) 公開日 平成20年6月19日(2008.6.19)

(51) Int. Cl.

B29C 33/58 (2006.01)

F1

B29C 33/58

テーマコード(参考)

4F202

審査請求 未請求 請求項の数 24 O L (全 21 頁)

(21) 出願番号 特願2006-326659 (P2006-326659)  
 (22) 出願日 平成18年12月4日(2006.12.4)

(71) 出願人 503002662  
 小川 一文  
 徳島県阿波市土成町土成字寒方50番地3  
 (72) 発明者 小川 一文  
 徳島県阿波市土成字寒方50-3  
 Fターム(参考) 4F202 AH73 AJ09 CA30 CB01 CM47  
 CM84

(54) 【発明の名称】 金型とその製造方法及びそれを用いて作製した成型品

(57) 【要約】

【課題】 光学部品など、ナノレベルでの精度を必要とする金型成形において、従来のような形状の改良や離型剤をスプレー塗布するような方法では、離型剤膜厚にばらつきが生じるため、精度が悪くなる。さらに、成型品に離型剤が付着すると不都合な場合もある。しかしながら、離型剤を使用しない金型は、未だ実用化されていない。

【課題を解決するための手段】

本発明の金型は、ナノレベルで膜厚が均一で、且つ表面エネルギーを制御した撥水撥油性のフッ化炭素系化学吸着膜を、離型膜として金型表面に形成したものである。このことにより、ナノメートルレベルの超微細形状を有していても、成型物の流動性や入り込み性に優れ、高精度の成形を行えるようになる。さらに離型剤塗布が不要となり、離型剤が成型品に付着するのを防止できる。

【選択図】 図2

